Development of an OTR Beam Profile Monitor for 3-50 Beam Transport Line

in J-PARC

Masaki Tejima^{#,A)}, Yoshinori Hashimoto^{A)}, Mitsuhashi Toshiyuki^{B)}, Satoru Otsu^{C)}

A) KEK/J-PARC

2-4 Shirakata Shirane, Tokai, Naka-Gun, Ibaraki, 319-1195 ^{B)} KEK 1-1 OHO, Tsukuba, Ibaraki, 305-0801 ^{C)} Mitsubishi Electric System & Service Co.,Ltd

2-8-8 Umezono, Tsukuba, Ibaraki, 305-0045

Abstract

A Beam Profile Monitor using the Optical Transition Radiation (OTR) in the beam transport line (3-50BT) between 3GeV Rapid-cycling synchrotron (RCS) and 50GeV Main ring (MR) has been planned in the J-PARC. The OTR monitor is conventionally used as a quasi-nondestructive, two-dimensional beam profile monitor for a beam having larger γ (above 10). Since the γ of beam is 4.2, opening angle the OTR is very wide in our case, and optics with extremely wide acceptance will be necessary for effective-extraction of the OTR from target. For this purpose, we placed a target (aluminum foil,10µm thickness) normal to the beam orbit, and collecting the back emitted OTR by Offner type mirror system. The offner system is designed to collect 500mrad opening angle of OTR, and enough good field of 100mm x 100mm for large beam size (about 60mm in diameter). The summary of the plan of the OTR profile monitor and selection of it's location, and development of the Offner system are described in this paper.

J-PARC 3-50BT の OTR ビーム・プロファイル・モニタの開発

1. はじめに

大強度陽子加速器施設(J-PARC)の加速器は、 Linac, 3 GeV Rapid Cycling Synchrotron (RCS) Main Ring (MR) から構成されている。RCS から輸 送路(3-50BT)を通って、MR に入射された陽子 ビームは 30 GeV まで加速され、 「遅い取り出しラ イン」によってハドロン実験施設へ、「速い取り出 しライン」によって T2K 実験(東海-神岡間長基線 ニュートリノ振動実験)を行うニュートリノ実験施 設へ送られる[1]。この 3-50BT には、図1に示すよ うに 14 台のビーム位置モニタ、約 30 台のビームロ スモニタ、6 台のマルチワイヤビームプロファイル モニタおよび5台のビーム電流モニタが既に設置さ れており、3-50BT のビーム軌道やビームロス、ビー ムサイズの測定などに有効に活用されてきた。 l かし、今後 MR ビームの大強度化を目指すにあたっ て、ビームコアの 2 次元プロファイルとビームハ ローの2次元分布を測定することが要求されたため、 遷移放射(OTR)光を光源に用いた光学的にビーム の像を観測できる 2 次元プロファイルモニタを開発 することになった。

2. OTR モニタ

J-PARC においては、MR における入射ビームの 設計上の許容エミッタンスは、54 π mm mrad であ る。しかし RCS から取り出されるビームは 216π mm mrad 程度のハローを持つため、MR でビームロ スが発生し、MR トンネル全体が残留放射能で汚染 され、保守点検作業が困難となる。そのため、RCS から取り出されたビームに付随してくるハローを 3-50BT の上流部に設置されたコリメータで除去して、 MR にビームのコア部分のみ入射する設計になって いる[2]。そのためにはビームの2次元的なプロファ イルを測定し、効率よくビームコアの部分のみを切 りだす必要がある。そのビームプロファイル測定は、 常時監視できることが望ましいので非破壊的に行う 必要がある。

この目的のために耐熱、耐放射線性に優れた非破 壊的ビーム・プロファイル・モニタが検討され、自



図1: 3-50BT の既存のビームモニタ装置

身が発生するビームロスによる残留放射能を抑えて、 ビームラインのメインテナンス性を損なわないよう にすることも考慮した結果、そのようなビームモニ タとして、金属薄膜をターゲットとするほぼ非破壊 的なモニタである OTR 光を用いたビーム・プロ ファイル・モニタを開発することになった。

3. 3-50BT における OTR について

3.1 OTR 光の強度と放射角について

光学的遷移放射、OTR 光は超相対論的な荷電粒子 が金属箔などのターゲットを通過する際に真空と物 質の境界面で放射される[3]。ビームが金属ターゲッ トに垂直に入射されるときには、ビームの軸方向に 鋭い放射角にラディアル偏光で放射され、放射強度 の最大方向は、ほぼ 1/γ である。OTR の放射の角度 広がりは、

$$I(\theta) = \frac{1}{\gamma^2} \left| \frac{-\sin(\theta)}{1 - \beta \cos(\theta)} \right|^2$$

で与えられる[4]。3-50BT の陽子ビームは3 GeV の エネルギーに加速されており、 γ は 4.2 になる。図 2に γ が 4.2 の場合について OTR の放射角を計 算したものを示す。



図2: γ=4.2のOTR 放射角

γ が小さいのに伴って OTR の放射強度が最大に なる角は±13.5 度である。したがって、今回の場合 のように、3 Gev 陽子ビームよりの OTR を光源に 用いてビームプロファイルを光学的に観測するため には、この大きな放射角に対応することが重要にな る。

3.2 OTR の可視光における強度

OTR のスペクトルは長波長から短波長まで伸び ているが、結像系に使用するには可視光の部分を使 うのが便利である。スペクトルの周波数ω1、ω2の 間に陽子 1 個から放射される OTR の光子数 N は、 次式で与えられる[5]。

$$N(\gamma) = \frac{\alpha}{\pi} \left| \ln(2\gamma) - \frac{1}{2} \right| \ln\left(\frac{\omega_2}{\omega_1}\right)$$

ここで α は微細構造定数である。この式を用いて、 アルミニウムターゲットから放射される OTR の波 長領域 400nm 800nm の範囲について積分した OTR 強度の γ 依存性を γ が 2 から 100 までの範囲に ついて計算した結果を図 3 に示す。この図から判る ように、 γ が 4 から 13 (1 2 GeV PS に相当)まで 変化しても OTR の強度は 2 倍ほどしか変化しない。 OTR が γ の比較的小さい陽子加速器において光学 式のプロファイルモニタとして用いられるのはこの ためである。



3.3 金属ターゲットにおけるビームロス

3 GeV 陽子ビームの OTR に使用する金属ター ゲットは、厚さ数 10 ミクロンのアルミ箔とチタン 箔を選択する。この金属ターゲットに陽子ビームが 入射され通過するときにビームのエネルギー・ロス を起こす。



図4: 陽子ビームのストッピング・パワー

その大きさを National Institute of Standards and Technology (NIST)のホームページ[6]で公開されている計算コードとデータベースに基づいて計算し、図4に示す。図はアルミニウムに数 keV~10GeV の陽子ビームを照射した場合のストッピング・パワーのプロットであるが、3 GeV の陽子ビームの場合、Stopping Power を図4から読み取ると、

$$\left(\frac{1}{\rho}\frac{dE}{dX}\right) = 1.619 \left[MeVcm^2/g\right]$$

となり、アルミニウムの比重が 2.69g/cm³ で上の 値を割ると、

$$\frac{dE}{dX} = 0.436 [keV / \mu m]$$

となる。厚さ 10 ミクロンのアルミ・ターゲット に対して 陽子ビーム 1 個当たりのエネルギー・ロ スは、約 4.36 keV になる。これは 4x10¹³ 個の陽子 ビームに対して 2.2 nW のパワー・ロスに相当する。 この程度のパワー・ロスであるならば、放射化と熱 変形に対して心配はないと思われます。チタンの場 合も同様の結果を得た。

4. ターゲットの配置とオフナー光学系の 設計

4.1 ターゲットの配置

前節に述べたように、ターゲットとしてはアルミ ニウムの薄膜を用いるが、今までの OTR モニタに よく見られるような、ビーム軸に対して 45°ター ゲットをかたむけて、OTR をビーム軸に対して 90°の方向から観測するように配置すると、ビーム サイズが 60mm と大きいのと、ハローまで観測する ように広い視野(100mm x 100mm 程度)を取ろうと すると、テレセントリック光学系を用いない限り、 ビームの像を被写界深度の中に入れることが出来な いので、今回はターゲットをビーム軸に対して直角 に配置することとした。

4.2 OTR 取り出しのためのオフナー光学系

図-2 に示すような大きな発散角を持った OTR を 有効に取り入れるためには、45°傾けた平面鏡によ り OTR を有効に取り出すことは難しい。一方で軸 はずし放物面ミラー、または回転楕円面ミラーがに よって OTR を取り出すことは可能であるが、視野 が広いので収差が問題となる。そこで、比較的大口 径においても収差の補正がある程度可能なオフナー 光学[7] による OTR 取り出し光学系をデザインした。 図5にオフナー光学系のミラー配置を示す。



図5: 大広角オフナー・リレー・システム

オフナー光学系はダイソンの光学系[8]を反射光学 系に置き換えたもので、単純な 2 枚の同心球面鏡か ら構成される(実用上は凹面鏡が大きくなるのを防ぐ ために凹面鏡を必要な面積の 2 枚に分けることが多 い)。上下左右の非対称配置から生じる非点収差が 大口径では気になるが、これについては凹面鏡と凸 面鏡の距離を同心からはずすことにより実用上問題 のない程度に軽減することが出来る。今回設計した システムでは開口径が 300mm で F=0.75 である。ま た、第一の凹面鏡には陽子ビームを通すための 120mmの穴を設けている。図6に 100mm x 100mm のグリッドパターンについてレイトレースした結果 を示す。これを見ると視野全面に渡って、非点収差 は補正されており、ほぼ平坦な像が得られることが わかる。



図6: 100mm x 100mm のグリッドパターンにつ いてレイトレースした結果

ピントは大口径でもあるので、かなり甘く、空間 分解能は 1mm 程度以上は期待できないが、陽子 ビームハサイズが大きいので。これで十分である。

4.3 ハロー・モニタ

3-50BT で輸送する陽子ビーム・バンチの粒子数

は、最大で4x10¹³ / bunch の陽子数である。MR へは 通常 8 個のバンチを入射する。そのビームサイズは OTR モニタ設置場所で直径が約 60 mm の断面にな る。ビームハローはビームコアの粒子数に対して 1%以下になると仮定すると、ビームハローの検出 感度は少なくとも、その10分の1以下、即ちビー ムコアの0.1%以下で測定する必要がある。

そのような感度で測定するために、ビームハロー のみの OTR を発生するように、コロナグラフのア イデアからヒントを得て、穴開きターゲットを採用 することにした(図7)。この場合、オフナー光学 システムの視野が広いことが条件になるが、ベンチ 試験[9]では、水平に約±100 mm、垂直に+50 mm ~-60 mm と広いため、ビームハローを視野に入れるこ とができる。

Beam core Beam halo Beam halo

図7: ハローモニタ用の OTR ターゲット

5. OTR プロファイルモニタ設置場所

OTR プロファイルモニタの光学システムが大型に なるため、真空容器も必然的に大きくなる。そのた め、設置場所はクレーンなどの移動用重機が使える 場所に限定される。また不要なビームロスを避ける ため 3-50BT のビームオプティクス上の βx 、 $\beta y と$ ηx 、 ηy が小さい場所を選択した。図8の矢印 (QDC1 と QFC2 の間)に設置する予定である。そ の場所は他に比べ加速器運転で受ける被ばく線量が 小さい(21 mGy / month)場所であることを確認し た。



参考文献

- [1] "Accelerator Technical Design Report for J-PARC", KEK-Report 2002-13 and JAERI-Tech 2003-044.
- [2] M. J. Shirakata, T. Oogoe, Y. Takeuchi and M. Yoshioka, Proceedings of EPAC 2006, Edinburgh, Scotland
- [3] I. Frank and V. Ginzburg, J. Phys. USSR 9, 353 (1945).
- [4] J. Bosser, J. Mann, G. Ferioli, and L.Wartski, NIM, A238, p45 (1985).
- [5] L. Wartski, S. Roland, J. Lasalle, M.Bolore, and G. Filippi, J. Appl. Phys. Vol46, No.8, p3644 (1975).
- [6] http://www.nist.gov/pml/data/star/index.cfm
- [7] A.Offner, 1975 "New Concepts in projection mask aligners" Opt. Eng. 14: 131
- [8] J. Dyson, 1959 "Unit-magnification optical system without Seidel aberrations" J.Opt.Soc. Am. 49: 713
- [9] S.Otsu, et al., These Proceedings